

<p>公開番号 又は 特許番号</p>	<p>特許 5369209</p>
<p>発明名称</p>	<p>マルチプローブ、記録装置、及びマルチプローブの製造方法</p>
<p>出願人 又は 権利者</p>	<p>東芝、東京大学</p>
<p>想定デバイス</p>	<p>アンビエントデバイス、その他</p>
<p>要約</p>	<p><b>【利用分野】</b> MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) メモリに用いられるマルチプローブに関するもの。</p> <p><b>【発明の内容】</b> 各マイクロプローブを個別に制御可能なマルチプローブを安価かつ容易に作製できること。そのために、表面にベース電極を有する土台と、前記土台から突出し、かつ第1の方向に並列してなる複数のマイクロプローブとを有するマルチプローブが提供される。前記マイクロプローブの少なくともいずれかは、カンチレバー、第1電極層、第2電極層を有し、前記第1電極層、および前記第2電極層の一の部分は前記カンチレバーの第1主面に形成され、かつ、前記第1電極層および前記第2電極層の一の部分は電氣的に接続し、前記第2電極層の一の部分および前記ベース電極は電氣的に接続し、前記第1主面は前記第1の方向に直交する面として規定され、前記第1の方向とは異なる第2の方向に直交する面として第2主面が規定される。</p>
<p>図面</p>	